

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000171346 A

(43) Date of publication of application: 23.06.00

(51) Int. CI

G01M 11/00 G11B 7/135

(21) Application number: 10349072

(22) Date of filing: 08.12.98

(71) Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor:

YOSHIDA SHINYA

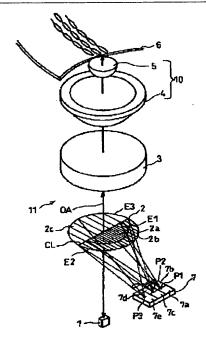
(54) ABERRATION DETECTING DEVICE AND **OPTICAL PICKUP DEVICE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aberration detecting device capable of properly performing the recording and regeneration of the information which respect to an optical magnetic disc by precisely detecting and properly correcting a spherical aberration caused in a condensing optical system, and an optical pickup device having this aberration detecting device.

SOLUTION: A light detecting device 7 for detecting the optical beam passed through a condensing optical system 10 comprises light detectors 7a, 7b for forming the condensing spot P1 of a first optical beam closer to an optical axis OA and light detectors 7c, 7d for forming the condensing spot P2 of a second optical beam on the outer side from the first optical beam. The spherical aberration of the condensing optical system 10 is detected on the basis of the detection signals of the detectors 7a-7d.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO



(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-171346 (P2000-171346A)

(43)公開日 平成12年6月23日(2000,6,23)

(51) Int.Cl.'

觀別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G01M 11/00 G11B 7/135 G 0 1 M 11/00 G11B 7/135 L 2G086

Z 5D119

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

特顏平10-349072

(22)出願日

平成10年12月8日(1998.12.8)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 吉田 慎也

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 100080034

弁理士 原 謙三

Fターム(参考) 20086 EE02 HH06

50119 AA11 AA22 BA01 BB05 CA09 DA01 DA05 ECO1 FA05 JA15 JA16 JA18 JA44 JB02 KA02

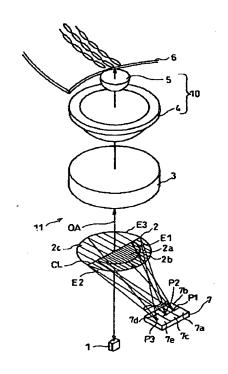
KA17 KA20 LB07

(54) [発明の名称] 収差検出装置および光ピックアップ装置

(57)【要約】

【課題】 集光光学系に生じる球面収差を精度良く検出 し、且つ適切に補正することで、光磁気ディスクに対す る情報の記録および再生を適切に行い得る収差検出装置 およびこれを備えた光ピックアップ装置を提供する。

【解決手段】 集光光学系10を通過した光ビームを検 出する光検出装置7は、光軸0Aに近い側の第1の光ビ ームの集光スポットP1を形成する光検出器7a・7b と、該第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームの集 光スポットP2を形成する光検出器7c・7dとを有す る。これら検出器 7 a ~ 7 d の検出信号に基づいて、上 記集光光学系10の球面収差を検出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】集光光学系を通過した光ビームの光軸に近い側の第1の光ビームと、該第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームとの2つの焦点位置に基づいて、該集光光学系の球面収差を検出する検出手段を有することを特徴とする収差検出装置。

【請求項2】上記検出手段は、

上記第1および第2の光ビームをそれぞれ独立して受光 する第1および第2受光部と、

上記集光光学系を通過した光ビームから上記第1および 10 第2の光ビームを分離して、それぞれ第1および第2受 光部に導くホログラムとを有し、

上記各受光部の出力に基づいて、上記集光光学系の球面 収差を検出することを特徴とする請求項1記載の収差検 出装置。

【請求項3】上記ホログラムは、

上記集光光学系を通過した光ビームの光軸に直交する直線と、該光軸を中心とする第1の半円とに囲まれた第1 の領域と、

上記光軸を中心とし上記第1の半円よりも大きな半径を 20 有し、且つ上記直線に関して上記第1の半円と同じ側の 第2の半円と、上記直線と、上記第1の半円とに囲まれ た第2の領域とを有し、

上記第1受光部は、

光信号を電気信号に変換する第1光検出器と第2光検出 器とが並置され、

上記第2受光部は、

光信号を電気信号に変換する第3光検出器と第4光検出 器とが並置され、

上記検出手段は、

上記ホログラムの第1の領域から導かれる第1の光ビームが上記第1受光部の第1光検出器と第2光検出器との境界部分に照射されることにより得られる上記第1光検出器と第2光検出器との電気信号の差と、

上記ホログラムの第2の領域から導かれる第2の光ビームが上記第2受光部の第3光検出器と第4光検出器との境界部分に照射されることにより得られる上記第3光検出器と第4光検出器との電気信号の差とを比較して、上記集光光学系の球面収差を検出することを特徴とする請求項2記載の収差検出装置。

【請求項4】上記第1光検出器で得られる電気信号をS1、上記第2光検出器で得られる電気信号をS2、上記第3光検出器で得られる電気信号をS3、上記第4光検出器で得られる電気信号をS4とした場合、上記集光光学系で生じる球面収差信号SAは、

 $SA = (S3 - S4) - (S1 - S2) \times K$

(Kは、係数である)で示されることを特徴とする請求項3記載の収差検出装置。

【請求項5】光源と、

上記光源から照射される光を記録媒体に集光させる集光 50

光学系と、

上記記録媒体に反射し、上記集光光学系を通過した光ビームの光軸に近い側の第1の光ビームと、該第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームとの2つの焦点位置に基づいて、該集光光学系の球面収差を検出する検出手段と、

上記検出手段の出力に基づいて、上記集光光学系の球面 収差を補正する収差補正手段とを備えていることを特徴 とする光ピックアップ装置。

) 【請求項6】上記検出手段は、

上記第1および第2の光ビームをそれぞれ独立して受光 する第1および第2受光部と、

上記記録媒体に反射し、上記集光光学系を通過した光ビームから上記第1および第2の光ビームをそれぞれ第1 および第2受光部に導くホログラムとを有し、

上記各受光部の出力に基づいて、上記集光光学系の球面 収差を検出することを特徴とする請求項5記載の光ピッ クアップ装置。

【請求項7】上記ホログラムは、

) 上記集光光学系を通過した光ビームの光軸に直交する直線と、該光軸を中心とする第1の半円とに囲まれた第1の領域と、

上記光軸を中心とし上記第1の半円よりも大きな半径を有し、且つ上記直線に関して上記第1の半円と同じ側の第2の半円と、上記直線と、上記第1の半円とに囲まれた第2の領域とを有し、

上記第1受光部は、

光信号を電気信号に変換する第1光検出器と第2光検出 器とが並置され、

30 上記第2受光部は、

光信号を電気信号に変換する第3光検出器と第4光検出 器とが並置され、

上記検出手段は、

上記ホログラムの第1の領域から導かれる第1の光ビームが上記第1受光部の第1光検出器と第2光検出器との境界部分に照射されることにより得られる上記第1光検出器と第2光検出器との電気信号の差と、

上記ホログラムの第2の領域から導かれる第2の光ビームが上記第2受光部の第3光検出器と第4光検出器との 境界部分に照射されることにより得られる上記第3光検 出器と第4光検出器との電気信号の差とを比較して、上 記集光光学系の球面収差を検出することを特徴とする請 求項6記載の光ビックアップ装置。

【請求項8】上記集光光学系は、少なくとも2つのレンズ要素が所定の間隔で配置された構造となっており、

上記収差補正手段は、上記検出手段の出力に基づいて、 上記レンズ要素の間隔を調整することで上記集光光学系 の球面収差を補正することを特徴とする請求項5ないし 7の何れかに記載の光ピックアップ装置。

【請求項9】上記検出手段は、上記第1受光部の第1光

2

検出器と第2光検出器との電気信号の差、あるいは上記 第2受光部の第3光検出器と第4光検出器との電気信号 の差の何れか一方に基づいて、記録媒体に対するフォー カス誤差を検出することを特徴とする請求項5ないし8 の何れかに記載の光ピックアップ装置。

【請求項10】上記検出手段による集光光学系の球面収 差検出後の球面収差情報を上記記録媒体の所定領域に記 録する収差情報記録手段が設けられていることを特徴と する請求項5ないし9の何れかに記載の光ピックアップ

【請求項11】上記収差情報記録手段は、検出手段によ る集光光学系の球面収差検出後、記録媒体装着時にのみ 記録媒体の所定領域に球面収差情報を記録することを特 徴とする請求項10記載の光ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、集光光学系におい て発生する球面収差を検出する収差検出装置およびこの 収差検出装置を備えた光ピックアップ装置に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】一般に、光ディスク装置において記録密 度を上げるためには、記録媒体である光ディスクの記録 再生に用いられる光の波長をできるだけ短くするか、光 ディスクに対して光を収束させる対物レンズの開口数 (NA)を大きくする必要がある。

【0003】ところで、光の波長を短くするには、より 波長の短いレーザ光を発生する半導体レーザを開発する 必要がある。しかしながら、このような半導体レーザを 開発するのは容易ではないことから、記録密度を上げる 30 ために、通常、上記した対物レンズの開口数を大きくす る方法が採用されている。

【0004】一方、対物レンズの開口数を大きくするに は、レンズの直径を大きくする方法が考えられるが、こ の場合、装置自体が大きなものとなる等の問題が生じ る。そこで、ソリッド・イマージョンレンズを用いて、 対物レンズの直径を大きくすることなく、対物レンズの 開口数を実効的に向上させる方法が検討されている。

【0005】例えば、特開平8-212579号公報に は、ソリッド・イマージョンレンズを用いた光ピックア 40 ップ装置が開示されている。この光ピックアップ装置 は、図6に示すように、対物レンズ112により集光さ れた光はプレート113とソリッド・イマージョンレン ズ114を介して光磁気ディスク111の基板111b を透過して情報記録層 1 1 1 a に集光され、該光磁気デ ィスク111を挟んでソリッド・イマージョンレンズ1 14と反対側に配置された磁気ヘッド115によって情 報の記録が行われる。

【0006】上記対物レンズ112は、周縁部において

倒部に対物レンズ112のフォーカス制御を行うための フォーカシングアクチュエータ119とトラッキング制 御を行うためのトラッキングアクチュエータ120とが 設けられている。

【0007】一方、上記ソリッド・イマージョンレンズ 114は、周縁部においてホルダ116に保持されると 共に、該ホルダ116の両側部にソリッド・イマージョ ンレンズ114とプレート113または対物レンズ11 2との間隔を調整するためのソリッド・イマージョンレ ンズアクチュエータ117が設けられている。

【0008】ここで、上記ソリッド・イマージョンレン ズ114は、光磁気ディスク111の基板111bとほ は同じ屈折率を有するガラスでできており、半球面は集 光点を中心とする球面となっているので、対物レンズ1 12で集光された光の開口数は基板111b内において 屈折率倍される。具体的に述べると、対物レンズ112 の開口数を0.55、ソリッド・イマージョンレンズ1 14の屈折率を1.5とすると実効的な開口数は0.8 3となる。

【0009】このように、ソリッド・イマージョンレン ス114を用いた集光光学系では、実効的な開口数が大 きくなるが、その分、光磁気ディスク111の基板11 1 b の厚み誤差や多層構造とした場合の基板 1 1 1 b の 厚みの変化により大きな球面収差が発生する。

【0010】したがって、上記のようにソリッド・イマ ージョンレンズ114と対物レンズ112とで構成され た集光光学系において、球面収差が発生した場合、ソリ ッド・イマージョンレンズアクチュエータ117を用い て、ソリッド・イマージョンレンズ114とプレート1 13または対物レンズ112との間隔を調整することに より、球面収差を補正するようになっている。

【0011】具体的には、ホルダ116とホルダ118 とに対向する電極をそれぞれ設け、該電極間の電気容量 を測定し、このときの電気容量が所定値となるように、 ホルダ116をソリッド・イマージョンレンズアクチュ エータ117によってホルダ118に対して移動させて 該ホルダ116とホルダ118との間隔を一定に保つこ とで、上記集光光学系の球面収差を疑似的に補正してい る。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した光 ピックアップ装置では、ホルダ116とホルダ118と の間の電気容量が所定値になるように、ホルダ116と ホルダ118との間隔を一定に保つことで、集光光学系 の球面収差を補正するようになっている。

【0013】したがって、上記光ピックアップ装置で は、上記の電気容量を測定することで、集光光学系の球 面収差が検出されることになる。

【0014】しかしながら、ホルダ116とホルダ11 ホルダ118に保持されると共に、該ホルダ118の両 50 8との間で測定される電気容量は、10pF足らずの非 5

常に小さな値であるので、光ピックアップ装置内の配線 等の浮遊容量により誤差を生じる虞があり、このような 場合、集光光学系に生じる球面収差を精度良く検出する ことができない。

【0015】このように、集光光学系に生じる球面収差を精度良く検出できなければ、発生した球面収差を適切に補正できず、この結果、光磁気ディスク111の情報記録層111aに対する情報の記録および再生を適切に行うことができないという問題が生じる。

【0016】本願発明は、上記の問題点に鑑みなされた 10 ものであって、その目的は、周囲の電気的なノイズに影響されることなく、集光光学系に生じる球面収差を精度良く検出する収差検出装置を提供すると共に、該収差検出装置を備えることで、集光光学系に生じる球面収差を適切に補正することができ、光磁気ディスクに対する情報の記録および再生を適切に行うことのできる光ピックアップ装置を提供することにある。

[0017]

【課題を解決するだめの手段】請求項1の収差検出装置は、上記の課題を解決するために、集光光学系を通過し 20 た光ピームの光軸に近い側の第1の光ピームと、該第1 の光ピームよりも外側の第2の光ピームとの2つの焦点位置に基づいて、該集光光学系の球面収差を検出する検出手段を有することを特徴としている。

【0018】上記の構成によれば、検出手段は、集光光学系を通過した光ビームを、光軸に近い側の第1の光ビームと、該第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームとに分け、それぞれの焦点位置から、該集光光学系の球面収差を検出するようになっている。これにより、集光光学系に発生する球面収差を光学的に検出することになる。

【0019】したがって、従来のように、集光光学系に 発生する球面収差を電気的に検出する装置に比べて、周 囲の電気的なノイズに影響されず、精度良く球面収差を 検出することができる。

【0020】このように、集光光学系の球面収差が精度 良く検出できれば、該集光光学系の球面収差の補正を適 切に行なうことができる。

【0021】上記の集光光学系の球面収差を検出する検出手段の具体例は、以下の請求項2ないし4のようにな 40る。

【0022】すなわち、請求項2の収差検出装置は、上記の課題を解決するために、請求項1の構成に加えて、検出手段は、第1および第2の光ビームをそれぞれ独立して受光する第1および第2受光部と、集光光学系を通過した光ビームから上記第1および第2の光ビームをそれぞれ第1および第2受光部に導くホログラムとを有し、各受光部の出力に基づいて、集光光学系の球面収差を検出することを特徴としている。

【0023】請求項3の収差検出装置は、上記の課題を 50 一ムと、該第1の光ビームよりも外側の第2の光ビーム

解決するために、請求項2の構成に加えて、ホログラム は、集光光学系を通過した光ピームの光軸に直交する直 線と、該光軸を中心とする第1の半円とに囲まれた第1 の領域と、上記光軸を中心とし上記第1の半円よりも大 きな半径を有し、且つ上記直線に関して上記第1の半円 と同じ側の第2の半円と、上記直線と、上記第1の半円 とに囲まれた第2の領域とを有し、上記第1受光部は、 光信号を電気信号に変換する第1光検出器と第2光検出 器とが並置され、上記第2受光部は、光信号を電気信号 に変換する第3光検出器と第4光検出器とが並置され、 上記検出手段は、上記ホログラムの第1の領域から導か れる第1の光ビームが上記第1受光部の第1光検出器と 第2光検出器との境界部分に照射されることにより得ら れる上記第1光検出器と第2光検出器との電気信号の差 と、上記ホログラムの第2の領域から導かれる第2の光 ビームが上記第2受光部の第3光検出器と第4光検出器 との境界部分に照射されることにより得られる上記第3 光検出器と第4光検出器との電気信号の差とを比較し て、上記集光光学系の球面収差を検出することを特徴と している。

【0024】請求項4の収差検出装置は、上記の課題を解決するために、請求項3の構成に加えて、第1光検出器で得られる電気信号をS1、第2光検出器で得られる電気信号をS3、第4光検出器で得られる電気信号をS3、第4光検出器で得られる電気信号をS4とした場合、上記集光光学系で生じる球面収差信号SAは、SA=(S3-S4)-(S1-S2)×K (Kは、係数である)で示されることを特徴としている。

【0025】上記の請求項2ないし4の構成によれば、 請求項1の作用に加えて、光学的に検出した集光光学系 の球面収差を検出信号として各受光部から出力すること で、この検出信号を用いて容易に集光光学系の球面収差 を補正することが可能となる。

【0026】このように、請求項1ないし4の収差検出 装置を備えた光ピックアップ装置として、以下の請求項 5ないし11の光ピックアップ装置が挙げれられる。

【0027】請求項5の光ピックアップ装置は、上記の課題を解決するために、光源と、上記光源から照射される光を記録媒体に集光させる集光光学系と、上記記録媒体に反射し、上記集光光学系を通過した光ピームの光軸に近い側の第1の光ピームと、該第1の光ピームよりも外側の第2の光ピームとの2つの焦点位置に基づいて、該集光光学系の球面収差を検出する検出手段と、上記検出手段の出力に基づいて、上記集光光学系の球面収差を補正する収差補正手段とを備えていることを特徴としている。

とに分け、それぞれの焦点位置から、該集光光学系の球 面収差を検出することで、光学的に球面収差を検出する

【0029】したがって、従来のように、集光光学系に 発生する球面収差を電気的に検出する装置に比べて、周 囲の電気的なノイズに影響されず、精度良く球面収差を 検出することができる。

【0030】そして、収差補正手段は、上記検出手段に より精度良く検出された球面収差に基づいて、集光光学 系の球面収差を補正するようになっているので、光記録 10 媒体に対して情報の記録あるいは再生を適切に行なうこ とができる。

【0031】集光光学系の球面収差の検出の具体的な装 置として、以下に示す請求項6および7の光ピックアッ ブ装置が挙げられる。

【0032】すなわち、請求項6の光ピックアップ装置 は、上記の課題を解決するために、請求項5の構成に加 えて、検出手段は、第1および第2の光ビームをそれぞ れ独立して受光する第1および第2受光部と、記録媒体 に反射し、上記集光光学系を通過した光ピームから上記 20 第1および第2の光ピームをそれぞれ第1および第2受 光部に導くホログラムとを有し、上記各受光部の出力に 基づいて、上記集光光学系の球面収差を検出することを 特徴としている。

【0033】また、請求項7の光ピックアップ装置は、 上記の課題を解決するために、請求項6の構成に加え て、ホログラムは、集光光学系を通過した光ビームの光 軸に直交する直線と、該光軸を中心とする第1の半円と に囲まれた第1の領域と、上記光軸を中心とし上記第1 の半円よりも大きな半径を有し、且つ上記直線に関して 30 上記第1の半円と同じ側の第2の半円と、上記直線と、 上記第1の半円とに囲まれた第2の領域とを有し、上記 第1受光部は、光信号を電気信号に変換する第1光検出 器と第2光検出器とが並置され、上記第2受光部は、光 信号を電気信号に変換する第3光検出器と第4光検出器 とが並置され、上記検出手段は、上記ホログラムの第1 の領域から導かれる第1の光ビームが上記第1受光部の 第1光検出器と第2光検出器との境界部分に照射される ことにより得られる上記第1光検出器と第2光検出器と の電気信号の差と、上記ホログラムの第2の領域から導 かれる第2の光ビームが上記第2受光部の第3光検出器 と第4光検出器との境界部分に照射されることにより得 られる上記第3光検出器と第4光検出器との電気信号の 差とを比較して、上記集光光学系の球面収差を検出する ことを特徴としている。

【0034】また、検出した球面収差に基づいて、集光 光学系の球面収差の補正を行なう場合の具体例として、 以下の請求項8の光ピックアップ装置が挙げられる。

【0035】すなわち、請求項8の光ピックアップ装置 は、上記の課題を解決するために、請求項5ないし7の 50 ク6を回転駆動するスピンドルモータ9、光磁気ディス

何れかの構成に加えて、集光光学系は、少なくとも2つ のレンズ要素が所定の間隔で配置された構造となってお り、収差補正手段は、上記検出手段の出力に基づいて、 上記レンズ要素の間隔を調整することで上記集光光学系 の球面収差を補正することを特徴としている。

【0036】また、請求項9の光ピックアップ装置は、 上記の課題を解決するために、請求項5ないし8の何れ かの構成に加えて、検出手段は、上記第1受光部の第1 光検出器と第2光検出器との電気信号の差、あるいは上 記第2受光部の第3光検出器と第4光検出器との電気信 号の差の何れか一方に基づいて、記録媒体に対するフォ ーカス誤差を検出することを特徴としている。

【0037】上記の構成によれば、請求項5ないし8の 作用に加えて、検出手段によって、集光光学系の球面収 差と、記録媒体へのフォーカシングの誤差(フォーカス 誤差)とを同時に検出することができるので、基板の厚 みが異なる記録媒体を用いた場合において、確実に情報 の記録再生を行なうことができる。

【0038】請求項10の光ピックアップ装置は、上記 の課題を解決するために、請求項5ないし9の何れかの 構成に加えて、検出手段による集光光学系の球面収差検 出後の球面収差情報を上記記録媒体の所定領域に記録す る収差情報記録手段が設けられていることを特徴として いる。

【0039】上記の構成によれば、請求項5ないし9の 作用に加えて、集光光学系の球面収差情報が記録媒体の 所定領域に記録されるようになるので、同一記録媒体に 対して情報の再生および記録を行なう場合には、再び球 面収差を検出する必要がなくなる。

【0040】請求項11の光ピックアップ装置は、上記 の課題を解決するために、請求項10の構成に加えて、 収差情報記録手段は、検出手段による集光光学系の球面 収差検出後、記録媒体装着時にのみ記録媒体の所定領域 に球面収差情報を記録することを特徴としている。

【0041】上記の構成によれば、請求項10の作用に 加えて、記録媒体装着時にのみ集光光学系の球面収差が 検出され、球面収差情報が該記録媒体に記録されるよう になるので、光ピックアップ装置における収差補正に係 る装置、例えばレンズ要素間隔を調整する装置の動作速 度は低速でも良い。これにより、収差補正に係る装置の 製造費を低減することができる。

[0042]

【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態について図 1ないし図5に基づいて説明すれば、以下の通りであ る。なお、本実施の形態では、集光光学系の球面収差を 検出する収差検出装置を備えた光ピックアップ装置を有 する光ディスク記録再生装置について説明する。

【0043】本実施の形態に係る光ディスク記録再生装 **闡は、図2に示すように、記録媒体である光磁気ディス** (6)

ク6に記録された情報を再生するための光ピックアップ 装置11、上記スピンドルモータ9および光ピックアッ プ装置11を駆動制御するための駆動制御部12、図示 しないが、光磁気ディスク6に情報を記録するための磁 気ヘッドを備えている。

【0044】上記光ピックアップ装置11は、半導体レ ーザ(光源) 1、ホログラム2、コリメートレンズ3、 対物レンズ (レンズ要素) 4 およびソリッド・イマージ ョンレンズ (レンズ要素) 5からなる集光光学系10、 および光検出装置(検出手段)?を有している。

【0045】また、集光光学系10とコリメートレンズ 3との間には、集光光学系 10からの光ビームあるいは コリメートレンズ3からの光ピームの光路を約90°屈 折させるミラー8が配設されている。

【0046】さらに、上記対物レンズ4は、周緑部にお いてホルダ13により保持されており、このホルダ13 の外周部にはフォーカスアクチュエータ14が設けられ ている。このフォーカスアクチュエータ14により、対 物レンズ4を光軸方向に移動させるようになっている。 これにより、フォーカスアクチュエータ14を駆動制御 20 することで、対物レンズ 4 を適切な位置に移動させてフ ォーカシング制御を行なうようになっている。

【0047】また、上記ソリッド・イマージョンレンズ 5は、周縁部においてホルダ15に保持されており、こ のホルダ15の外周部にはソリッド・イマージョンレン ズアクチュエータ16が設けられている。このソリッド ・イマージョンレンズアクチュエータ16により、ソリ ッド・イマージョンレンズ5を光軸方向に移動させるよ うになっている。これにより、ソリッド・イマージョン レンズアクチュエータ16を駆動制御することで、ソリ 30 ッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を 調整し、集光光学系10で生じる球面収差を補正するよ うになっている。

【0048】上記駆動制御部12は、スピンドルモータ 9の駆動制御を行うスピンドルモータ駆動回路17、フ ォーカスアクチュエータ14の駆動制御を行うフォーカ - ス駆動回路18、ソリッド・イマージョンレンズアクチ ュエータ16の駆動制御を行うソリッド・イマージョン レンズ駆動回路19、上記のスピンドルモータ駆動回路 17、フォーカス駆動回路18、ソリッド・イマージョ ンレンズ駆動回路19への制御信号を生成するための制 御信号生成回路20、光検出装置7から得られた信号か ら情報を再生し、再生信号を生成するための情報再生回 路21からなる。

【0049】ここで、上記光ピックアップ装置11につ いて図1を参照しながら詳細に説明する。なお、説明の 便宜上、図1に示す光ピックアップ装置11では、図2 で示したミラー8については省略している。

【0050】上記光ピックアップ装置11において、ホ

ソリッド・イマージョンレンズ5は、半導体レーザ1の 出射面と光磁気ディスク6の反射面との間に形成される 光軸〇A上に配置され、光検出装置7はホログラム2の 回折光の焦点位置近傍に配置されている。

【0051】したがって、上記光ピックアップ装置11 において、半導体レーザ1から出射された光 (以下、光 ビームと称する)は、ホログラム2で0次回折光として 透過し、コリメートレンズ3によって平行光に変換され た後、対物レンズ4およびソリッド・イマージョンレン 10 ズ5を介して光磁気ディスク6上の所定の位置に集光さ れる。一方、光磁気ディスク6から反射された光ビーム は、ソリッド・イマージョンレンズ5、対物レンズ4、 コリメートレンズ3を通過してホログラム2に入射さ れ、該ホログラム2にて回折されて光検出装置7上に集 光される。

【0052】上記ホログラム2は、光軸0Aに直交する 直線CLと該光軸OAを中心とする第1の半円E1とで 囲まれた第1の領域2a、上記第1の半円E1と上記直 線CLと第1の半円E1よりも半径が大きく、且つ第1 の半円E1側の第2の半円E2と上記直線CLとで囲ま れた第2の領域2b、上記直線CLに対して第1の半円 E1および第2の半円E2とは反対側の第3の半円E3 と直線CLとで囲まれた第3の領域2cの3つの領域を 有している。

【0053】上記ホログラム2は、半導体レーザ1側か らの出射光を回折せずにそのまま光磁気ディスク 6 側に 透過させ、光磁気ディスク6側からの反射光を回折して 光検出装置7に導くようになっている。

【0054】そして、ホログラム2の各領域は、それぞ、 れの領域を光磁気ディスク6個から通過する光によって 各領域に対応する集光スポットが別々に形成されように 形成されている。これにより、ホログラム2の3つの領 域を光磁気ディスク6側から通過する光は、3箇所の集 光スポットを形成するようになる。

【0055】また、光検出装置7は、5つの光検出器7 a~7eで構成されている。光検出器(第1光検出器) 7 a · 光検出器 (第2光検出器) 7 b を並置して第1受 光部を形成し、光検出器 (第3光検出器) 7 c · 光検出 器 (第4光検出器) 7 dを並置して第2受光部を形成 し、光検出器7 e は単独で第3受光部を形成している。

【0056】したがって、上記ホログラム2の各領域で 回折された光ビームは、それぞれ光検出装置7の各受光 部に導かれる。

【0057】すなわち、光磁気ディスク6で反射された 光ビームの光軸OAに近い側の第1の光ビームとなる第 1の領域2aからの光ビームによって、第1受光部を構 成する光検出器7aと光検出器7bとの境界線上に集光 スポットP1が形成され、第1の光ピームよりも外側の 第2の光ビームとなる第2の領域2bからの光ビームに ログラム2、コリメートレンズ3、対物レンズ4および 50 よって、第2受光部を構成する光検出器7cと光検出器

7 dとの境界線上に集光スポット P 2 が形成され、光磁 気ディスク6の情報信号となる第3の領域2cからの光 ビームによって、第3受光部を構成する光検出器7eに 集光スポットP3が形成されるようになっている。

【0058】また、上記の光検出器7a~7eは、いず れも受光した光(光信号)を電気信号に変換するように なっており、変換した電気信号を前述した制御信号生成 回路20および情報再生回路21に出力するようになっ ている。

【0059】したがって、光検出装置7の第1受光部の 10 光検出器7a・7bには、光磁気ディスク6で反射さ れ、ソリッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ 4からなる集光光学系10を通過した光ピームのうち、 ホログラム2の光軸OAに近い側の第1の領域2aで回 折される第1の光ビームが入射されるようになってい る。

【0060】また、光検出装置7の第2受光部の光検出 器7c・7dには、光磁気ディスク6で反射され、ソリ ッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ4からな る集光光学系10を通過した光ビームのうち、ホログラ 20 ム2の上記第1の領域2aよりも外側に形成された第2 の領域2bで回折される第2の光ビームが入射されるよ うになっている。

【0061】さらに、光検出装置7の第3受光部である 光検出器7 eには、光磁気ディスク6で反射され、ソリ ッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ4からな る集光光学系10を通過した光ビームが、ホログラム2 の第3の領域2cで回折され、入射されるようになって いる。

【0062】上記の各光検出器7a~7eにおいて、受 30 光された光信号は、それぞれ電気信号S1~S5に変換 される。

【0063】各光検出器7a~7eで得られた電気信号 は、図2に示す制御信号生成回路20に出力され、集光 光学系10における対物レンズ4やソリッド・イマージ ョンレンズ5の移動調整に使用される。

【0064】また、上記電気信号は、情報再生回路21 に出力され、再生信号に変換される。すなわち、光磁気 ディスク6に記録された情報信号(再生信号)RFは、 RF = S1 + S2 + S3 + S4 + S5で与えられる。

【0065】ここで、光磁気ディスク6の基板の厚さ や、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4と の相対位置等が適切で球面収差が発生していない状態に おいて、該光磁気ディスク6上に正しく焦点が結ばれて いるとき、つまり、合焦時には、各光検出器7a~7e に形成される集光スポットP1~P3の形状は、図3

(b) に示すように、それぞれがほほ同じ大きさの点と

【0066】このとき、ホログラム2にて回折される光

集光スポットP1は、光検出器7aと7bに対して照射 面積が等しくなるように形成される。つまり、光検出器 7 a から得られる電気信号 S 1 と、光検出器 7 b から得 られる電気信号S2との値が等しいことを示している。 【0067】ここで、光磁気ディスク6に照射される光 ビームの焦点誤差を示す焦点誤差信号FESは、

12

FES=S1-S2

で表される。

【0068】したがって、上述のように光検出器 7 a と 7 bとで得られる電気信号S1とS2との値が等しいと き、すなわち、合焦時には、焦点誤差信号FESは0と なっている。

【0069】また、光磁気ディスク6に照射される光ビ ームの焦点がずれた場合、光検出器7a~7eに形成さ れる集光スポットP1~P3は半円状に拡がる。例えば 光磁気ディスク6が対物レンズ4から遠ざかる方向に移 動すると、図3(a)に示すように、集光スポットP1 は光検出器7b上に半円状に拡がる。これに対して、光 磁気ディスク6が対物レンズ4に近づく方向に移動する と、図3(c)に示すように、集光スポットP1は光検 出器7a上に半円状に拡がる。

【0070】すなわち、光磁気ディスク6が対物レンズ 4から遠ざかる方向に移動する場合には、光検出器 7 b により変換された電気信号 S 2 の値の方が、光検出器 7 aにより変換された電気信号S1の値よりも大きくな り、焦点誤差信号FESは負の値を示す。

【0071】一方、光磁気ディスク6が対物レンズ4に 近づく方向に移動する場合には、光検出器7aにより変 換された電気信号S1の値の方が、光検出器7bにより 変換された電気信号S2の値よりも大きくなり、焦点誤 差信号FESは正の値を示す。

【0072】したがって、上記焦点誤差信号FESを0 にするには、対物レンズ4を保持するホルダ13に設け られたフォーカスアクチュエータ14によって、該対物 レンズ4を光軸 O A 方向に移動させることにより行われ る。このときのフォーカス駆動回路18によるフォーカ スアクチュエータ14の駆動量は、光検出器7aと7b とで得られる電気信号S1とS2とに基づいて、制御信 号生成回路20で得られた制御信号によって調整され

【0073】一般に、光磁気ディスク6の基板の厚み や、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4と の相対位置等が適切でない場合には、上記構成の光ピッ クアップ装置の集光光学系10において球面収差が発生

【0074】この球面収差とは、集光光学系の中心部を 通過する光ビームの焦点と周辺部を通過する光ビームの 焦点とのずれを言う。

【0075】このように、集光光学系10において球面 ビームのうち、光軸OA側の第1の光ビームが合焦した 50 収差が発生した場合、該集光光学系10において合焦状

S が 0 で保たれない場合、この焦点誤差信号 F E S を考慮して、球面収差信号 S A は以下のようになる。 【 0 0 8 2 】

態、すなわち光検出器 7 a と 7 b との電気信号の差が 0 である状態であっても、例えば図 4 (a) や図 4 (c) に示すように、光検出器 7 c と 7 d との電気信号の差が 0 でなく、正あるいは負の値をとるようになる。これにより、正あるいは負の球面収差が発生したことが示される。

【0076】例えば球面収差のない状態、且つ合焦状態では、集光光学系10を構成するソリッド・イマージョンレンズ5および対物レンズ4を通過する全ての光ビームは、図5(b)に示すように、光軸OA上の光磁気ディスク6の一点に集光される。このときの光検出装置7における各光ビームの集光スポットP1~P3の形状は、図4(b)に示すようになる。

【0077】これに対して、上記集光光学系10に正あるいは負の球面収差が発生した場合には、上記集光光学系10を通過する光ビームは、図5(a)および図5(c)に示すように、光磁気ディスク6の一点に集光されない。ここでは、光軸OAに近い側の光ビームの焦点位置が光磁気ディスク6上の適切な位置にあることを前提とし、例えば、集光光学系10において正の球面収差が発生した場合、図5(a)に示すように、該集光光学系10の周辺部の光ビームの焦点位置が光軸OAに近い側の光ビームの焦点位置よりもソリッド・イマージョンレンズ5から遠くになる。一方、集光光学系10において負の球面収差が発生した場合、図5(c)に示すように、該集光光学系10の周辺部の光ビームの焦点位置が光軸OAに近い側の光ビームの焦点位置よりもソリッド

【0078】したがって、焦点誤差信号FESが0となるようにフォーカスアクチュエータ14により対物レンズ4が駆動された状態において、光磁気ディスク6の基板の厚みが所定寸法と異なる寸法であるため、例えば正の球面収差が生じたとすると、集光光学系10の周辺部の光ビームは光磁気ディスク6がソリッド・イマージョンレンズ5に近づいたときと同様な変化を示すので光検出器7c・7dの集光スポットP2の形状は、図4

・イマージョンレンズ 5 に近くなる。

(c) に示すように、光検出器7c上に半ドーナッツ状に拡がる。

【0079】逆に、負の球面収差が生じたとすると、集 光光学系10の周辺部の光ビームは光磁気ディスク6が 40 ソリッド・イマージョンレンズ5から遠ざかったときと 同様な変化を示すので光検出器7 c・7 dの集光スポットP2の形状は、図4(a)に示すように、光検出器7 d上に半ドーナッツ状に拡がる。

【0080】したがって、焦点誤差信号FESが0で保たれている場合、集光光学系10で発生した球面収差を示す信号である球面収差信号SAは、各光検出器7a~7eから得られる電気信号S1~S5を用いて示せば以下のようになる。

【0081】SA=S3-S4また、焦点誤差信号FE 50 対物レンズ4との間隔を調整し、その後はこのレンズ間

SA=(S3-S4)-(S1-S2)×K (K は定数である)

14

上記の球面収差信号SAは、制御信号生成回路20で生成され、ソリッド・イマージョンレンズ駆動回路19に出力される。

【0083】したがって、ソリッド・イマージョンレンズ駆動回路19は、上記球面収差信号SAに基づいて、ソリッド・イマージョンレンズ5を保持しているホルダ15の外周部に設けられたソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16を駆動制御して、球面収差を補正するようになっている。

【0084】つまり、ソリッド・イマージョンレンズ駆動回路19は、球面収差信号SAが正の球面収差を示すとき、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を長くする方向に、ソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16を駆動制御し、逆に球面収差を示すとき、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を短くする方向に、ソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16を駆動制御するようになっている。

【0085】このように、球面収差信号SAに基づいて、集光光学系10で発生する球面収差がなくなるよう補正すれば、情報の再生を行う場合、光磁気ディスク6に記録された情報の再生を良好に行うことができる。また、情報の記録を行う場合、図示しない磁気ヘッドを光磁気ディスク6を挟んで光ビックアップ装置11とは反対側に配置すれば、該光磁気ディスク6への情報の書き込みも良好に行うことができる。

【0086】また、上記球面収差の補正は、光磁気ディスク6を光記録再生装置に装着した時に行っても良いし、光磁気ディスク6を光記録再生装置に装着した後、情報の記録あるいは再生を行っている間に適宜行っても良い。

【0087】つまり、例えば、半導体レーザ1によって、光検出装置7による集光光学系10の球面収差検出後の球面収差情報を上記光磁気ディスク6の所定領域に 記録するようにする。すなわち、半導体レーザ1は、光検出装置7による集光光学系10の球面収差検出後、光磁気ディスク6の装着時にのみ該光磁気ディスク6の所定領域に球面収差情報を記録する。

【0088】例えば、光磁気ディスク6の基板厚みのばらつきが一枚のディスク内で一定値以内に抑えられている場合には、光磁気ディスク6の交換時の最初に球面収差検出を行なって、半導体レーザ1によって球面収差情報を光磁気ディスク6の所定の領域に記録し、この球面収差情報に従って、ソリッド・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を調整し、その後はこのレンズ間

隔を保つようにすれば良い。この場合、光磁気ディスク 6の交換時のみ集光光学系10の球面収差の補正を行な うことになる。また、半導体レーザ1は、光磁気ディス ク6の所定領域に球面収差情報を記録する収差情報記録 手段の機能を兼ねている。

【0089】一方、光磁気ディスク6の基板厚みのばら つきが一枚のディスク内で大きなばらつきがある場合に は、記録および再生中に常に収差量を検出し、ソリッド ・イマージョンレンズ5と対物レンズ4との間隔を変え て球面収差の補正を行う。この場合、光磁気ディスク 6 の記録および再生時に常に集光光学系10の球面収差の 補正を行うことになる。このとき、集光光学系10の球 面収差の検出は、光磁気ディスク6に対する情報の記録 あるいは再生中に常に行なわれるようになるので、検出 した球面収差情報は光磁気ディスク6に記録しないよう にする。

【0090】以上のように、光磁気ディスク6の交換時 のみ集光光学系10の球面収差の補正を行う場合には、 補正の時間は多少長くかかっても良いので、集光光学系 10の対物レンズ4とソリッド・イマージョンレンズ5 とのレンズ間隔を調整するソリッド・イマージョンレン ズアクチュエータ16は低速動作のものが使用できる。 これにより、球面収差の補正が行なえる光ピックアップ 装置を安価に製造することができる。

【0091】一方、光磁気ディスク6の記録再生時に常 に集光光学系10の球面収差の補正を行なう場合には、 光磁気ディスク6の回転速度に応じた速度で反応する高 速のソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ16 が必要となるが、ディスク厚さの製造公差を大きくとれ るので、光磁気ディスク6の製造コストを低減すること が可能となる。

【0092】なお、本実施の形態では、光磁気ディスク 6に反射した光ビームを光検出装置7に導くための手段 として、ホログラム2を使用したが、これに限定される ものではなく、例えば、ビームスプリッタと半円形ある いは半ドーナッツ形に分割されたウェッジプリズムを組 み合わせたものを使用しても良い。しかしながら、装置 の小型化を図る点からは、ホログラム2を使用するのが 好ましい。

【0093】また、焦点誤差信号FESを決定するため 40 に、集光光学系10を通過した光ビームのうち、光軸0 Aに近い側の光ビーム(第1の光ビーム)が光検出装置 7において合焦するか否かで行なっていたが、これに限 定されるものではなく、集光光学系10を通過した光ビ ームのうち、該集光光学系10の周縁部の光ビーム(第 2の光ビーム)が光検出装置7において合焦するか否か で行なっても良い。しかしながら、集光光学系10の周 縁部の光ビームである第2光ビームは球面収差の影響を 受け易く、焦点位置を精密に調整し難いので、光軸OA に近い側の光ビームである第1の光ビームを用いて焦点 50 側の第2の半円と、上記直線と、上記第1の半円とに囲

誤差を調整することが好ましい。

【0094】さらに、本実施の形態では、対物レンズ4 とソリッド・イマージョンレンズ5とを組み合わせた集 光光学系10の球面収差の検出および収差補正について 述べたが、本願発明は、これに限定されるものではな い。例えば、複数のレンズ要素を組み合わせた集光光学 系にも適用可能である。

16

[0095]

【発明の効果】請求項1の発明の収差検出装置は、以上 のように、集光光学系を通過した光ビームの光軸に近い 側の第1の光ビームと、該第1の光ビームよりも外側の 第2の光ビームとの2つの焦点位置に基づいて、該集光 光学系の球面収差を検出する検出手段を有する構成であ **Z** -

【0096】それゆえ、検出手段は、集光光学系を通過 した光ビームを、光軸に近い餌の第1の光ビームと、該 第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームとに分け、 それぞれの焦点位置から、該集光光学系の球面収差を検 出するようになっている。これにより、集光光学系に発 生する球面収差を光学的に検出することになる。

【0097】したがって、従来のように、集光光学系に 発生する球面収差を電気的に検出する装置に比べて、周 囲の電気的なノイズに影響されず、精度良く球面収差を 検出することができる。

【0098】このように、集光光学系の球面収差が精度 良く検出できれば、該集光光学系の球面収差の補正を適 切に行なうことができるという効果を奏する。

【0099】請求項2の発明の収差検出装置は、以上の ように、請求項1の構成に加えて、検出手段は、第1お よび第2の光ビームをそれぞれ独立して受光する第1お よび第2受光部と、集光光学系を通過した光ビームから 上記第1および第2の光ビームをそれぞれ第1および第 2 受光部に導くホログラムとを有し、各受光部の出力に 基づいて、集光光学系の球面収差を検出する構成であ

【0100】それゆえ、請求項1の構成による効果に加 えて、球面収差検出に必要な第1および第2の光ピーム を別々の受光部に導くためにホログラムが使用されてい るので、より小さく、簡単な構成で、光ビームを所望す る方向に回折させることができるという効果を奏する。

【0101】上記のホログラムおよび光検出器を具体的 に使用した例は、以下の請求項3および4の発明の光ピ ックアップ装置がある。

【0102】請求項3の発明の収差検出装置は、以上の ように、請求項2の構成に加えて、ホログラムは、集光 光学系を通過した光ビームの光軸に直交する直線と、該 光軸を中心とする第1の半円とに囲まれた第1の領域 と、上記光軸を中心とし上記第1の半円よりも大きな半 径を有し、且つ上記直線に関して上記第1の半円と同じ

まれた第2の領域とを有し、上記第1受光部は、光信号を電気信号に変換する第1光検出器と第2光検出器とが並置され、上記第2受光部は、光信号を電気信号に変換する第3光検出器と第4光検出器とが並置され、上記検出手段は、上記ホログラムの第1の領域から導かれる第1の光ビームが上記第1受光部の第1光検出器と第2光検出器との境界部分に照射されることにより得られる上記第1光検出器と第2光検出器との電気信号の差と、上記ホログラムの第2の領域から導かれる第2の光ビームが上記第2受光部の第3光検出器と第4光検出器との境 10界部分に照射されることにより得られる上記第3光検出器と第4光検出器との電気信号の差とを比較して、上記集光光学系の球面収差を検出する構成である。

17

【0103】請求項4の発明の収差検出装置は、以上のように、請求項3の構成に加えて、第1光検出器で得られる電気信号をS1、第2光検出器で得られる電気信号をS2、第3光検出器で得られる電気信号をS3、第4光検出器で得られる電気信号をS4とした場合、上記集光光学系で生じる球面収差信号SAは、

 $SA = (S3 - S4) - (S1 - S2) \times K$ (Kは、係数である)

で示される構成である。

【0104】請求項5の発明の光ピックアップ装置は、以上のように、光源と、上記光源から照射される光を記録媒体に集光させる集光光学系と、上記記録媒体に反射し、上記集光光学系を通過した光ピームの光軸に近い側の第1の光ピームと、該第1の光ピームよりも外側の第2の光ピームとの2つの焦点位置に基づいて、該集光光学系の球面収差を検出する検出手段と、上記検出手段の出力に基づいて、上記集光光学系の球面収差を補正する 30収差補正手段とを備えている構成である。

【0105】それゆえ、検出手段は、集光光学系を通過した光ビームを、光軸に近い側の第1の光ビームと、該第1の光ビームよりも外側の第2の光ビームとに分け、それぞれの焦点位置から、該集光光学系の球面収差を検出することで、光学的に球面収差を検出することになる。

【0106】したがって、従来のように、集光光学系に 発生する球面収差を電気的に検出する装置に比べて、周 囲の電気的なノイズに影響されず、精度良く球面収差を 40 検出することができる。

【0107】そして、収差補正手段は、上記検出手段により精度良く検出された球面収差量に基づいて、集光光学系の球面収差を補正するようになっているので、上記構成の光ピックアップ装置を用いていれば、記録媒体に対して惰報の記録あるいは再生を適切に行なうことができるという効果を奏する。

【0108】 集光光学系の球面収差の検出の具体的な装置として、以下に示す請求項6および7の発明の光ピックアップ装置が挙げられる。

18 の光ピュ

【0109】請求項6の発明の光ピックアップ装置は、以上のように、請求項5の構成に加えて、検出手段は、第1および第2の光ピームをそれぞれ独立して受光する第1および第2受光部と、記録媒体に反射し、上記集光光学系を通過した光ピームから上記第1および第2の光ピームをそれぞれ第1および第2受光部に導くホログラムとを有し、上記各受光部の出力に基づいて、上記集光光学系の収差を検出する構成である。

【0110】また、請求項7の発明の光ピックアップ装 置は、以上のように、請求項6の構成に加えて、ホログ ラムは、集光光学系を通過した光ビームの光軸に直交す る直線と、該光軸を中心とする第1の半円とに囲まれた 第1の領域と、上記光軸を中心とし上記第1の半円より も大きな半径を有し、且つ上記直線に関して上記第1の 半円と同じ側の第2の半円と、上記直線と、上記第1の 半円とに囲まれた第2の領域とを有し、上記第1受光部 は、光信号を電気信号に変換する第1光検出器と第2光 検出器とが並置され、上記第2受光部は、光信号を電気 信号に変換する第3光検出器と第4光検出器とが並置さ 20 れ、上記検出手段は、上記ホログラムの第1の領域から 導かれる第1の光ビームが上記第1受光部の第1光検出 器と第2光検出器との境界部分に照射されることにより 得られる上記第1光検出器と第2光検出器との電気信号 の差と、上記ホログラムの第2の領域から導かれる第2 の光ビームが上記第2受光部の第3光検出器と第4光検 出器との境界部分に照射されることにより得られる上記 第3光検出器と第4光検出器との電気信号の差とを比較 して、上記集光光学系の球面収差を検出する構成であ る。

0 【0111】また、検出した球面収差の補正を行なう具体的な装置として、以下の請求項8の発明の光ピックアップ装置が挙げられる。

【0112】請求項8の発明の光ピックアップ装置は、 以上のように、請求項5ないし7の何れかの構成に加え て、集光光学系は、少なくとも2つのレンズ要素が所定 の間隔で配置された構造となっており、収差補正手段 は、上記検出手段の出力に基づいて、上記レンズ要素の 間隔を調整することで上記集光光学系の球面収差を補正 する構成である。

40 【0113】また、請求項9の発明の光ピックアップ装置は、以上のように、請求項5ないし8の何れかの構成に加えて、検出手段は、第1受光部の第1光検出器と第2光検出器との電気信号の差、あるいは第2受光部の第3光検出器と第4光検出器との電気信号の差の何れか一方に基づいて、記録媒体に対するフォーカス誤差を検出する構成である。

【0114】それゆえ、請求項5ないし8の構成による 効果に加えて、検出手段によって、集光光学系の球面収 差と、記録媒体へのフォーカシングの誤差(フォーカス 50 誤差)とを同時に検出することができるので、基板の厚 みが異なる光記録媒体を用いた場合において、確実に情報の記録再生を行なうことができるという効果を奏する。

【0115】請求項10の発明の光ピックアップ装置は、以上のように、請求項5ないし9の何れかの構成に加えて、検出手段による集光光学系の球面収差検出後の球面収差情報を上記記録媒体の所定領域に記録する収差情報記録手段が設けられている構成である。

【0116】それゆえ、請求項5ないし9の構成による効果に加えて、集光光学系の球面収差情報が記録媒体の 10 所定領域に記録されるようになるので、同一記録媒体に対して情報の再生および記録を行なう場合には、再び球面収差を検出する必要がなくなる。これにより、同一記録媒体に対して繰り返し、情報の記録や再生を行なう場合、2回目以降の情報の記録や再生の動作を迅速に行なうことができるという効果を奏する。

【0117】 請求項11の発明の光ピックアップ装置は、以上のように、請求項10の構成に加えて、収差情報記録手段は、検出手段による集光光学系の球面収差検出後、記録媒体装着時にのみ記録媒体の所定領域に球面収差情報を記録する構成である。

【0118】それゆえ、請求項10の構成による効果に加えて、記録媒体装着時のみ集光光学系の球面収差が検出され、収差情報が該記録媒体に記録されるようになるので、光ピックアップ装置における収差補正に係る装置、例えばレンズ要素間隔を調整する装置の動作速度は低速でも良い。これにより、収差補正に係る装置の製造費を低減することができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ピックアップ装置の概略構成図であ 30 る。

【図2】図1に示す光ピックアップ装置を備えた光ディスク記録再生装置の概略構成図である。

*【図3】(a)~(c)は、図1に示す光ピックアップ 装置における光ビームの焦点がずれた場合の光検出器上 での集光スポットの形状変化を示す説明図である。

20

【図4】(a)~(c)は、図1に示す光ピックアップ 装置が有する集光光学系で球面収差が生じた場合の光検 出器上での集光スポットの形状変化を示す説明図であ る。

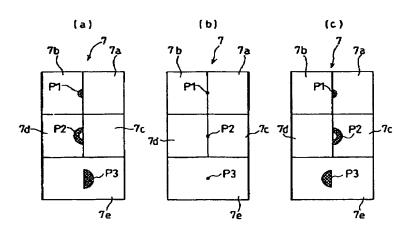
【図5】(a)~(c)は、図1に示す光ピックアップ 装置が有する集光光学系で発生する球面収差を示す説明 図である。

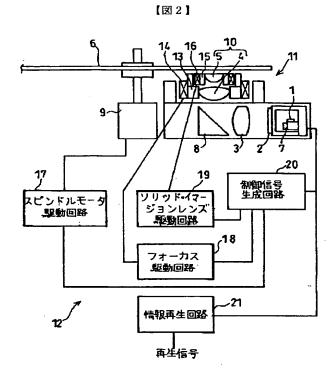
【図 6 】従来の光ピックアップ装置の概略構成図である。

【符号の説明】

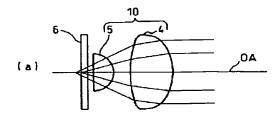
- 1 半導体レーザ (光源、収差情報記録手段)
- 2 ホログラム
- 2 a 第1の領域
- 2 b 第2の領域
- 4 対物レンズ (レンズ要素)
- 5 ソリッド・イマージョンレンズ (レンズ要素)
- 20 6 光磁気ディスク(記録媒体)
 - 7 光検出装置
 - 7 a 光検出器 (第1光検出器)
 - 7 b 光検出器 (第2光検出器)
 - 7 c 光検出器 (第3光検出器)
 - 7 d 光検出器 (第 4 光検出器)
 - 10 集光光学系
 - 16 ソリッド・イマージョンレンズアクチュエータ (収差補正手段)
 - CL 直線
- O E1 第1の半円
 - E2 第2の半円
 - OA 光軸

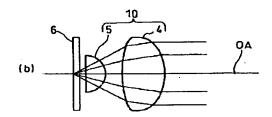
【図3】

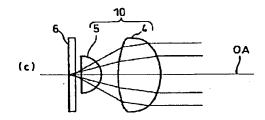












【図6】

